## 19:日本国特許庁

10 特許出願公開

# 公開特許公報

昭53--57559

51 Int. Cl.<sup>2</sup> F 26 B 17 14 識別記号

52日本分類 71 D 12 庁内整理番号 6743 34 43公開 昭和53年(1978)5月24日 発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

54 乾燥装置

21特

願 昭51--132337

22出 願昭51(1976)11月5日

72 発 明 者 赤崎淳

宇部市大字小串1978番地の10 宇部興産株式会社宇部窒素工場

内

同 片浦龟生

宇部市大字小串1978番地の10 宇部興産株式会社宇部窒素 I.場

内

同 岡田一夫

宇部市大字小串1978番地の10 宇部則産株式会社宇部窒素工場 内

72 発 明 者 山丈朝教

東京都千代田区霞が関3丁目7番2号 宇部興産株式会社東京

本社内

同 千葉泰久

東京都千代田区霞が関3丁目7 番2号 宇部興産株式会社東京

本社内

71出 願 人 宇部則産株式会社

宇部市西本町1丁目12番32号

明 細 雹

1. 発明の名称

乾燥装置

### 2 特許請求の範囲

(1) スラリー状の被乾燥物の入口及びガス抜口を上部に設け、被乾燥物出口を下部に設けたを垂直塔の内部に、外送り用の羽根を下面に設けたレーキを内送り用の羽根を下面に設けたレーキを投設配して回転自在に設け、軸心の通路を有する円板と外間部に下段で配しているのである円板を各レーキの下で配してで配いる場所を発している。上段部の円板の上面にないて、上のといったで設けた羽板の半径方向のは内ではいったで、外送り用もしくた乾燥装置を円周方向に断続的に設けた乾燥装置を円周方向に断続的に設けた乾燥装置

(2) 最上段のレーキの下に、凹みを有し、かつ、項部側に下段への通路を有するスチームポックスを垂直塔に固定して設け、スチームポックスの凹みの底部に垂直塔外へ通じる水抜管を取付けた特

許請求の範囲第1項記載の乾燥装置。

(3) 下段部に設けた円板の下面に、半割パイプを溶接して一定間隔に取付け、との半割パイプ門板上の被乾燥物に熱を与えて乾燥するスチーム通路とした特許請求の範囲第1項記載の乾燥装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

この発明はスラリー状の物質を効率良く乾燥する乾燥装置に関するものであり、例えば、軽質炭化水素との親和性を有する固体を含んだスラリー状の物質を効率良く乾燥しりるようにしたものである。

次に図面に示した1実施例によって、この発明を説明する。1は垂直塔であり、垂直塔1の上壁にはスラリー状の被乾燥物の入口2を設け、垂直塔1の周壁の上部には数個のガス抜口3を設け、下部には乾燥物出口4を設けた。垂直塔1の軸心部には、垂直な回転軸6を設け、回転軸6に水平なレーキ7を多数段配して取付けた。8は電動機、9はカサ歯車装置、10は軸受けである。

レーキ1の下面には、最上段のレーキ1から下

段に向けて交互に、外送り用の羽根11と内送り用の羽根12を半径方向に対して斜めに、かつ、 互に一定間隔離して取付けた。第2図には内送り 用の羽根12を設けたレーキ7を示す。但し第2 図にむいて、レーキ7は時計廻り方向に回転する 様にした。

第1~3段のレーキ7に設けた羽根11,12 は、その下端部が後述するスチームポックス13 や円板21,22の上面から少し離れた状態にあるようにしたが、第4段以降のレーキ7に設けた羽根12,11の下部を上下に揺動できる様にし、羽根12,11の下端部しくないスプリングの作用によって、もしくないスプリングの作用によって、略接登をではした。被乾燥物が良く乾燥した粉状になった時点では、塊状になって後述する支険がになった時点では、塊状になって後述する大にした。最上段のレーキ7の下には、垂直軸6の回り

(3)

の下面に密着させて多数設けた半割パイプ 2 6,マニホールド 2 7,スチーム排出管 2 8 によって構成した。そして円板 2 1,2 2 の下面に密着させて多数設けた半割パイプ 2 6 にスチームを通すととによって、円板 2 1,2 2 を加熱する様にした。

第2段及び第3段のレーキ7の下に設けた円板21,22の上面において,第2段及び第3段のレーキ7に設けた数個の羽根12,11の半径のロのすき間の位置に相当する部分に,外送り用の羽根30又は内送り用の羽根31を,中心から断続的に,円周方向に各2個だかいて,羽根12の外端は2点鎖線で示した軌跡を面いて回転するので,円板21に設けて,羽根12と羽根30が接触しないようにして,羽根12と羽根30が接触しないようにして,羽根12と羽根30が接触しないようにして,羽根12と羽根30が接触しないようにして,羽根12と羽根30が接触しないした。

勿論、羽根30は第2段、31は第3段の加熱板にだけに設けても良く、又は第4段以降の加熱

に内部が空洞なスチームボックス13を,垂直塔1の周壁に固定して設けた。スチームボックス13には逆円すい形状の凹み14を上側に設け、スチームボックス13の外周である頂部側にはリング状の下段への通路15を設けた。16はスチーム供給管,17はスチーム排出管であり、18はスチームボックス13の内周部に設けた堰である。

スチームポックス13の凹み14の底部には、 垂直塔1の外に通じる水抜管19を取付け、凹み 14部にある被乾燥物が例えば軽質炭化水素の他 に多くの水分を含み、水が凹み14部の下の方に たまり、被乾燥物がその上に浮いている場合に、 その水を初期乾燥の段階で抜取るよりにした。

第2段以降のレーキ7の下には、軸心部に下段へのリング状の通路20を有する円板21と、外周部に下段へのリング状の通路15を有する円板22を交互に配して垂直塔1に固定した。各円板21,22の下面にはスチーム通路を取付けた。スチーム通路は、第1、3図に示すよりに、スチーム供給管24、マニホールド25、円板21,22

(4)

板に設けてもよい。

この発明の乾燥装置は、例えば、軽質炭化水素 との親和性を有する固体を含んだスラリー状の物質を乾燥するのに適している。すなわち、ナフサ、 ペンセン、ヘキサンなどの軽質炭化水素とカーポンと水からなる物質の乾燥に適している。

抜出口まで流下する恐れがある。又、たとえ途中で蒸発するように工夫しても、その分だけ加熱原のスチームの消費が多くなり、かつ、所要伝熱面積も増加する等経済的に不利な面が多く、この水 抜出しの効果は多大である。

垂直塔1の上部では、ナフサとカーポンの混合

(7)

たためである。この型式をとることにより、製作面で安価になるだけでなく、ジャケットタイプよりも、より高圧力のスチームを加熱源に使用でき、そのより高い加熱温度によって被乾燥物の乾燥を上昇できるようになった。この半割パイプ26の取付ピッチを、加熱板上の被乾燥物の乾燥度、すなわち、伝熱率の違いによって、半割パイプ26の直径の2~10倍と変化させ、加熱面積に対するスチーム加熱面積の割合を%~%にし、むだな加熱をさけることができる。

このように、この発明においては、特許請求の 範囲に記載したような構造にしたので、乾燥能率 が極めて良い。特に、上段部の円板上にレーキの 羽根に合わせて、外送り用の羽根もしくは内送り 用の羽根を断続的に設けたので、被乾燥物の粉 砕、移動、乾燥が確実容易に行える。又、へ通じる 水抜管を取付けたので、エマルジョンを形成し、 水を多く含んだ炭化水素と被乾燥物スラリーから、 あらかじめ水を抜き取った後に乾燥することがで 物がスラリー状になっており、乾燥するにつれて、円板21,22上やレーキ7の羽根12,11間で塊状に固まる傾向があるが、この装置ではレーキの羽根12,11と上段部の円板21,22の上面に設けた羽根30,31の作動によって、円板21,22上の被乾燥物塊を粉砕したり、内側や外側に適宜移動させて攪拌するので、ナフサの蒸発やカーボンの乾燥が極めて効率良く行われる。

最上段を除く加熱円板21,22の加熱は、円板21,22の下面に密着させて多数設けた半割パイプ26を通るスチームによって行なわれるが、これは第4図に示すように半割パイプ26を一定間隔かいて設置してある。これは一般の間接加熱を関策機にかいては、伝熱率向上のため、加熱板下面は全面スチームジャケットにしたりしているが、この発明の伝熱率が悪いので、全面ジャケットタイプの加熱の場合も、本発明のようにスチーム伝熱面を加熱面積の光~%にしたものも、ほとんど乾燥効率に差がないということが判りしたものをはないということが判りしたものを表すたいということが判りしている。

(8)

き、効率の良い乾燥を行うことができる。 又、下部平板での加熱板に、半割パイプを多数密着した 平板を使用することにより、容易に製作しうるよ うにした。

したがって乾燥装置も比較的に小型のものを, 容易に得ることができる。

# 4. 図面の簡単な説明

図面はとの発明の1実施例を示すもので、第1 図は縦断面図、第2図は第1図のⅡ一Ⅱ線拡大断面図、第3図は第1図のⅢ一Ⅲ線断面図、第4図は円板加熱部の断面図である。

1・・・垂直塔, 2・・・被乾燥物の入口, 3・・・ガス 抜口, 4・・・乾燥物出口, 7・・・レーキ, 8・・・電動機, 11, 12・・・羽根, 13・・・スチームボックス, 14・・・凹み, 19・・・水抜管, 21, 22・・・円板, 26・・・半割パイプ, 30, 31・・・羽根

特許出願人 宇部興産株式会社



